cw 光注入による Fabry-Perot LD の

全光制御モード同期法の特性と二分周動作への応用

Lasing Characteristics and Application to Division of Repetition Frequency of All Optical Mode Locking of Fabry-Perot Laser Diodes by cw Light Injection

鈴木 基仁 †, 水池 秀仁 †, 森 正和 †, 西澤 典彦 ‡, 後藤 俊夫 ‡, 後藤 了祐 ‡ †, 山根 一雄 ‡ † Motohiro SUZUKI, Hidehito MIZUCHI, Masakazu MORI, Norihiko NISHIZAWA, Toshio GOTO, Ryosuke GOTO, Kazuo YAMANE

Abstract: The all optical mode locking of Fabry-Perot laser diodes enable us to generate optical pulse trains at high repetition frequencies. The method is based on the mutual injection locking of two longitudinal modes and successive injection locking of adjacent longitudinal mode. In this paper, the characteristics and applications of the method are investigated. It is found that the reproducibility is improved by using a SELFOC lens as the external cavity. Feasibility of division of the pulse repetition frequency is also quantitatively discussed with phase lock loop model.

1.はじめに

光通信システムにおける伝送速度の向上に伴って、 100Gbit/sクラスの光時分割多重方式(OTDM)を想定したパ ルス光源用の集積型モード同期レーザが盛んに研究され ている¹⁾。可飽和吸収体、EA 変調器、DBR 領域を集積し た構成であり、高周波を併用したハイブリッドモード同期 による高安定性の実現や、DBR 領域を電気的に制御する ことによる繰り返し周波数の可変幅増大が可能になって きている。また、これら集積型モード同期レーザの縦モー ドを取り出して、干渉させることにより、THz オーダーの 繰り返しビート信号を発生させることも行われている²⁾。

これに対し、我々は、特別構造のデバイスを用いないと いう方針で、制御性の良い高速パルスを発生させる手法を 検討してきた。これまでに、次の二つの手法を実験検討し てきている。

(1)Fabry-Perot LD(F-P LD)に cw 光を注入することによる全光制御モード同期法³⁾

(2)外部反射による F-P LD の自己モード同期現象を用 いた手法⁴⁾

(1)では、まず cw 光を励起光として F-P LD 中の二縦モードが相互注入同期し、次に、隣接した縦モードにそれらの四光波混合が注入されて従続的な注入同期が起きると

† 愛知工業大学 情報通信工学科(豊田市)

‡ 名古屋大学大学院 工学研究科(名古屋市)

‡ † 富士通株式会社 光開発推進部(川崎市)

いう現象が利用される。一方、(2)では、F-P LD の特定縦 モードが(1)における cw 注入光の役割を果たすことになる。 いずれの手法も、100GHz 以上の高繰り返し光パルス列を 発生することが可能である。本研究では、制御性の良さと いう観点から、(1)の cw 光注入方式を重点的に検討してき た。この方式では、cw 注入光の周波数を変化させること により、幅 30MHz~50MHz 程度の同期周波数範囲である ことが観測されている。この性質は、光 PLL などにおい て、繰り返し周波数を調整する上で有利である。

cw 光注入による全光制御モード同期法に関しては、再 現性の向上が最重要課題である。これまでに、結合用セル フォックレンズを外部共振器として用いることにより、再 現性の向上、及び同期周波数範囲の拡大が期待できるとの 結果が得られている⁵⁾。

本論文では、共振器長 300 µ m の F-P LD を用いて、実 験系での外部反射の抑圧法と共に、セルフォックレンズで の反射を積極利用する方法を検討した。また、一層の再現 性向上を図ることを目的として、外部共振器としての結合 用セルフォックレンズの効果をより詳細に調べた。

cw 光注入による全光制御モード同期法の原理を応用した、モード同期パルス列の繰り返し周波数の分周法と逓倍法の検討をこれまでに行っている^の。そこでは、定常位相と動作との関係を調べ、原理的な可能性を調べたのみであった。本論文では、二分周動作に絞って、位相同期ループ (PLL)モデルを用いた定量的な検討を進めた。定常位相を詳細に調べると共に、安定性解析を行った。

2. 再現性向上の検討

cw 光注入による全光制御モード同期法では再現性向上 が最も重要な課題である。これまでも、被注入 F-P LD の 共振器長や端面処理の状態によっては、パルス光が生成さ れなかったり、縦モード周波数間隔の整数倍ではない繰り 返し周波数でパルス列が発生したり、或いは、注入光の波 長を変化させるとパルスの繰り返し周波数が GHz オーダ 一で変化してしまうという現象が見られた⁷。これらの点 を実験で調べ、端面処理は AR-CL(無反射コート-劈開)の方 が CL-CL(劈開-劈開)よりもモード同期がかかり易いこと、 及び共振器長が 900μm 程度にまで長くなると、スペクト ルホールバーニングの影響によってモード同期がかかり にくい傾向にあることが分かっている⁵。実際、共振器長 900μm、端面処理 CL-CL の F-P LD を用いた時は、パルス 波形が全く観測されなかった。

cw 光注入による全光制御モード同期法においては、被 注入 F-P LD のスペクトル線幅は重要な動作パラメータで ある。そのため、光学系における光サーキュレータ等での 弱い外部反射があると、F-P LD のスペクトル線幅に影響 して、パルス列の特性が大きく変化してしまう。そこで、 外部反射の影響を抑圧、或いは積極的に利用する方法を検 討した。これまでに、LD と出力光学系との結合用セルフ オックレンズを外部共振器として用いる手法を考案し、共 振器長 900 µ m、端面処理 AR-CL の F-P LD を用いて実験 検討している⁵。

本論文では、共振器長 300 µ m の F-P LD で、その端面 処理が CL-CL のものと、AR-CL のものについて、フリー スペクトルレンジが被注入 F-P LD の縦モード間隔と整数 比なるように調整されたセルフォックレンズを外部共振 器として用いた場合の効果を調べた。共振器長 300 µ m と したのは、スペクトルホールバーニング等、他の不確定要 素を少しでも減らすためである。

3. 全光制御モード同期の原理

我々の提案している全光制御モード同期の原理を図 1 に示す³⁾。狭線幅 cw 光の周波数を F-P LD の主縦モードの 中心周波数に調整し、光アイソレータを介して直流駆動の F-P LD に注入する。このことにより、注入された cw 光は 縦モード f₁と f₊₁の非縮退四光波混合のポンプ光となり、 縦モード f₁と f₊₁の四光波混合成分がそれぞれ f₊₁と f₁の 周波数位置に生成される。この四光波混合成分によって、 二つの縦モード f₁と f₊₁は相互注入同期する。よって、相 対位相は固定され、当該縦モードの線幅は狭窄化される。 一度この相互注入同期が起こると、f₁と f₊₁の二つの縦

モード間の四光波混合成分が非縮退四光波混合によって

 $f_2 \ge f_{42}$ の周波数位置に生成される。その結果、 $f_2 \ge f_{42}$ の 縦モードはこれらの四光波混合成分によって注入同期さ れる。このように、注入同期された縦モードと隣り合った 縦モードの注入同期が次々と起こり、F-P LD は 1F-P モー ド間隔に等しい周波数でモード同期される。

注入同期を次々と起こすためには、縦モードの線幅を狭 くしておく必要がある。そこで、結合用セルフォックレン ズを外部共振器として用いる方式を提案した⁵⁾。

本方式は、cw 光注入のみでモード同期させるものであり、電気的な変調周波数の制限を受けない。従って、繰り返し100GHz以上の光パルス列の発生が可能である。



セルフォックレンズによるスペクトル線幅狭窄化の 効果

実験系を図 2 に示す。F-P LD には共振器長 300 μ m の 1.55 μ m 帯のものを用いた。端面処理は AR-CL、CL-CL の二種類とした。cw 注入光源には、狭線幅(≤ 100 kHz)の単 一縦モード波長可変 LD を用いた。cw 注入光パワーは、 エルビウム添加光ファイバ増幅器(Er 濃度 500ppm、25m) で増幅し、定偏波光サーキュレータ(Kaifa 製、挿入損失 0.6dB、反射減衰量 \geq 45dB)を用いて F-P LD の出力側端面 から注入した。

F-P LD の出力は光サーキュレータを介して、光スペク トラムアナライザ(アンリツ MS9710B、分解能 0.07nm)で 発振スペクトルを、confocal F-P 干渉計(フリースペクトル レンジ=2GHz)でスペクトル線幅を観測した。また、オー トコリレータ(inrad 製、分解能 0.1psec)でモード同期状態で のパルス波形を観測した。

結合用セルフォックレンズは、1.55µm用で両端平面の 0.25 ピッチのもの(日本板硝子製 H18-S0250-155-ABC、 NA=0.60)を使用し、そのフリースペクトルレンジがF-PLD の縦モード間隔と整数比になるように両端を研磨して用 いた。これにより、セルフォックレンズはF-PLDの外部 共振器として作用する。但し、セルフォックレンズとLD 端面との距離は、スペクトル線幅が狭くなるように調整す る必要がある。また、公称共振器長が同じLDであっても、 実際の共振器長にはバラツキがあるため、個々のLDに合 わせて研磨しなおした。

セルフォックレンズのフリースペクトルレンジ(FSR)は、 狭線幅の波長可変 cw 光源を用いて、F-P 干渉計としての セルフォックレンズの反射率の波長依存性を測定して求 めた。また、セルフォックレンズを研磨し過ぎないように 研磨と FSR 測定をこまめに繰り返した。



図2 実験系

4·1 共振器長 300µm、端面処理 劈開-劈開

共振器長 300 µm、端面処理が CL-CL の F-P LD を用い て外部共振器の効果を調べる実験を行った。

モード同期状態での発振スペクトルを図3、オートコリ レータ出力波形を図4に示す。F-P LD の直流電流は閾値 電流の9.1倍である。また、セルフォックレンズの反射率 の波長依存性を図5に示す。これから、セルフォックレン ズのFSRは23.2GHzと求められた。一方、F-P LD の縦モ ード間隔は139.3GHzであり、セルフォックレンズのFSR との比は整数(=6.00)となっている。

パルス列の繰り返し周波数は F-P LD の縦モード周波数 間隔に等しい 139GHz であり、オートコリレータ出力の半 値全幅は 2.9ps である。パルス振幅は 1 パルスおきに大き くなっており、このことから、cw 注入光と F-P LD の縦モ ードの相対位相が固定されていることが分かる³⁾。パルス 列の消光比は、あまり良くないが、これは、端面処理が CL-CL であるために注入光の影響を受けにくいからと考 えている。







波長依存性

この F-P LD では、外部共振器がない状態では cw 光注入 による全光制御モード同期は観測されていない。外部共振 器を設けることにより、初めてモード同期が起きる。

4・2 共振器長 300µm、端面処理 AR コート-劈開

外部共振器がある状態で、共振器長 300µm、端面処理 がAR-CLのF-PLDのモード同期状態での発振スペクトル を図6、オートコリレータ出力波形を図7に示す。F-PLD の直流電流は閾値電流の4.7倍である。このF-PLDにお いても、外部共振器がない状態では、cw光注入による全 光制御モード同期は全く観測されなかった。

セルフォックレンズの反射率の波長依存性を図8に示す。 これから、セルフォックレンズの FSR は 23.4GHz と求め られた。F-P LD の縦モード間隔は 141.0GHz であり、セル フォックレンズの FSR との比はほぼ整数(=6.03)となって いる。

図7において、パルス振幅は1パルスおきに上下に出て いるが、その理由は以下に述べるように、モード同期して いないからではなく、モード同期していて、且つ、cw 注 入光の強度が F-P LD の全縦モード強度の和よりも大きい からである。パルス列の繰り返し周波数は F-P LD の 1F-P モード間隔に等しい 141GHz であり、オートコリレータ出 カの半値全幅は 1.4ps である。cw 注入光の周波数を MHz 単位で変化させると、モード同期が起きている間は、 confocal F-P 干渉計で観測した F-P LD の発振スペクトルが 追随していく様子を観測することができる。この現象を利 用して、同期周波数範囲を測定したところ、±87MHz で あった。外部共振器が無くてもモード同期した F-P LD で は、同期周波数範囲は±50MHz であった³⁾。したがって、 外部共振器を用いた時のほうが同期周波数範囲は広がる と考えられる。



図 6 モード同期時の発振スペクトル(300 µ m, AR-CL)



図7 モード同期時のパルス波形(300 µ m, AR-CL)



図8 研磨したセルフォックレンズの反射率の 波長依存性

図7において、パルス振幅が1パルスおきに上下に出て いる理由について述べる。この状況を、cw 注入光の電界 を基準ベクトルとしたベクトル図で示すと、図9のように なる。





図9 cw 注入光強度の大きさによるモード同期時の 合成電界の振幅変化における違い

時刻 t=0 で cw 注入光の電界と F-P LD の全縦モードの電 界の位相が揃っているとする。この時から縦モード間隔の 逆数 T だけ時間が経過すると、cw 注入光のベクトル方向 に対して、F-P LD のベクトル方向が反対に揃う。cw 注入 光の強度が小さい場合は、cw 注入光を含めた全体の合成 電界の方向は F-P LD の全縦モードの合成電界の方向に支 配される。したがって、全体の合成電界の振幅は、(a)に示 したように、1 パルスおきに大きくなる。一方、cw 注入光 の強度が大きい場合は、全体の合成電界の方向が cw 注入 光の電界方向に支配される。そのため、全体の合成電界の 振幅は 1 パルスおきに上下に出ることになる。つまり、図 7 において、パルス振幅が 1 パルスおきに上下に出るのは、 cw 注入光の強度が大きい状態でモード同期しているから である。

LD の温度や電流を変化させると、微小ではあるが縦モ ード周波数間隔が変わって、外部共振器としてのセルフォ ックレンズの効果に差が現れる。

温度をほぼ最適にした条件下で、cw 注入光パワーを一 定とし(偏波制御器出力で8.0mW~8.9mW)直流バイアス電 流を変化させた時のオートコリレータ出力波形を図 10 に 示す。直流バイアス電流が大きいほどモード同期がかかり 易いという訳ではなく、40mA 近辺が最も安定してモード 同期がかかるという傾向であった。

この LD は、反射を利用した自己モード同期の実験にお いても 40mA 近辺がモード同期し易いという傾向にあった⁴⁾。

直流電流 40mA(4.7I_{th}、I_{th} は閾値電流)の条件下で、cw 注 入光のパワーを変化させたときの発振スペクトルとオー トコリレータ出力波形を図 11 に示す。cw 注入光パワーが 3.8mW(光サーキュレータ入力時)であれば、パワーの増加 と共にパルス幅が狭くなっていく様子が分かる。この LD については、cw 注入光を止めても、自己モード同期によ って繰り返し周波数 280GHz のパルスが発生した。但し、 cw 注入光がある場合には、自己モード同期は抑圧される ことを確認している。

同期状態と非同期状態での各縦モードのスペクトル線 幅を図 12 に示す。各縦モードを回折格子分光器(分解能 0.35nm、挿入損失 9.5dB)で取り出し、エルビウム添加光フ ァイバ増幅器で増幅した後に confocal F-P 干渉計で観測し た。同図には、cw 注入光より短波長側の四本の縦モード ($\lambda_{-1} \sim \lambda_{-4}$)の発振スペクトル線幅の変化を示してある。縦 モード $\lambda_{-1} \sim \lambda_{-3}$ は、同期状態のスペクトル線幅が非同期 状態の時よりも狭くなっていることが分かる。縦モード λ_{-4} のスペクトル線幅の変化は、使用した confocal F-P 干 渉計の感度では、はっきりと確認できなかった。また、cw 注入光より長波長側の縦モードについても、少なくとも3 モード分は同期状態でスペクトル線幅が狭くなることを 確認している。すなわち、少なくとも中心縦モードから±3モード分はモード同期していることを直接的に確認できた。

オートコリレータ出力波形の半値全幅は 1.4ps であるか ら、ガウス波形と仮定すると光パルスの半値全幅は 1.0ps となる。これから、モード同期に関与している縦モード数 は、おおよそ(1/1.0ps)/141GHz=7 となり、上記の測定結果 と定性的に合っている。







図 12 同期/非同期における各縦モードの スペクトル線幅(H:400MHz/div)

5. パルス波形の整形法

本モード同期法では cw 注入光を用いているため、この cw 注入光成分を調整することによって出力光パルスの波 形整形が可能である。図13にパルス波形の整形法を示す。 図9のベクトル図より、出力光から cw 注入光の成分を除 去すれば、繰り返し周波数が F-P LDの縦モード周波数間 隔に等しく、且つ、パルス振幅が一定の光パルス列になる ことが分かる。また、注入光成分の強度を制御して、cw 注入光の電界成分と F-P LD の全縦モード電界成分の和の 大きさを等しくすれば、時刻 T の時はトータルの電界はキ ャンセルされて打ち消しあうので電界はゼロとなる。した がって、縦モード周波数間隔の半分に等しい繰り返し周波 数でパルスが発生していることになる。すなわち、光パル ス列の二分周に用いることができる。

現在は、cw 注入光成分の除去方法、或いは強度調整方法として、ファイバ・ブラッグ・グレーティングや Fabry-Perot 干渉計などの光フィルタを用いる方法、cw 注 入光と F-P LD の偏光方向を互いに垂直とする方法を検討 している。

cw 注入光と LD 出力光の偏光方向が直交した状態でも モード同期すれば、光フィルタの代わりに、単に偏光子を 用いればよいことになる。また、我々が提案してきた、光 学的原理によるモード同期パルス列の繰り返し周波数の 分周法や逓倍法⁶に適用する上でも有利になる。



図13 パルス波形の整形法

6. 二分周動作の解析

高繰り返し光パルス列の繰り返し周波数の分周法や逓 倍法は、光伝送や光信号処理に応用する上で不可欠な技術 である。この内で、繰り返し周波数の逓倍法については、 分波・遅延・合波という OTDM 的手法や、Fabry-Perot 干 渉計による高調波スペクトルの抜き出しという簡易な手 法によっても可能である。したがって、繰り返し周波数の 分周法に重点をおいて検討を進める方が意義が大きい。

我々は、Fabry-Perot型LDにおける縦モード間の相互注 入同期を用いた、全光学的な手法による、高繰り返しモー ド同期光パルス列の繰り返し周波数の分周法と逓倍法を 提案した⁶。これまでは定常位相と動作との関係を調べた のみであった。本論文では、二分周動作に絞って、位相同 期ループ(PLL)モデルを用いて定量的な検討を進めた。定 常位相を詳細に調べると共に、安定性解析を行った。

6・1 二分周動作での定常位相

二分周での周波数配置を図14に示す。モード同期した、 縦モード周波数間隔 f₀の F-P LD₁出力を、縦モード周波数 間隔 f₀/2 の F-P LD₂に図の周波数配置で注入する。これに より、F-P LD₁の各縦モード出力を励起光として、実線で 結んだ F-P LD₂の縦モードが二つずつ組となって相互注入 同期する(…、M₁、M₀、M₁、M₂、…)。F-P LD₁の各縦モ ード出力の位相を 0 にとると、この過程により、安定な定 常状態では二つの縦モードが互いに逆数となる(…、± ϕ_{-1} 、 ± ϕ_{0} 、± ϕ_{1} 、± ϕ_{2} 、…)。しかし一般には、その大きさ は組毎に異なる。したがって、このままでは F-P LD₂ はモ ード同期しない。モード同期のためには、相互注入同期し た縦モード組間で、F-P LD₂内の四光波混合(FWM)による 相互注入同期(破線)が起きることが必要である。これによ って、注入同期した組毎に位相が確定していく。



次に、各過程を順に追ってみる。

(1)cw 注入光による二縦モードの相互注入同期過程

二つの縦モードの組毎(…、 M_1 、 M_0 、 M_1 、 M_2 、…)に相 互注入同期が起きる。組 M_0 について考えると、cw 光の位 相を θ_{cw} 、モード番号 0 の位相を θ_0 、モード番号-1 の位相 を θ_{-1} として、安定な定常状態では次式が成り立つ(図 15 の PLL モデル参照)。

$$\begin{cases} 2 \theta_{cw} - \theta_{-1} = \theta_{0} \pmod{2\pi} : 励起光=注入 cw 光 で、
モード-1 の FWM 成分がモード 0 へ注入
2 \theta_{cw} - \theta_{0} = \theta_{-1} \pmod{2\pi} : 励起光=注入 cw 光 で、
モード 0 の FWM 成分がモード-1 へ注入
\end{cases}$$
(1)

これから、 $\theta_{-1} + \theta_{0} = 2 \theta_{cw} = 0$ となる。但し、cw 光位相 $\theta_{cw} = 0$ とした。つまり、 $\theta_{0} = -\theta_{-1} \equiv \phi_{0}$ であり、二つの縦モード の位相は互いに逆符号となる。

同様なことが他の縦モードの組(…、 M_1 、 M_1 、 M_2 、…) についても言える。但し、図 14 に示したように、各組の 位相(…、± ϕ_{-1} 、± ϕ_0 、± ϕ_1 、…)は任意であるため、こ のままではモード同期は生じない。



図 15 相互注入同期の PLL モデル

(2)相互注入同期した縦モード組の間の相互注入同期過程 モード同期のためには、相互注入同期した縦モードの組 同士が、FWM により相互注入同期することが不可欠であ る。例えば、縦モードの組 M₁ と M₀の相互注入同期を考 えると、安定な定常状態では次式が成り立つ。

これから、 $\phi_0=n\pi/4$ (n=-3~+4)、 $\phi_{-1}=-3\phi_0$ となる。すな わち、隣接する二つの組が相互注入同期しさえすれば、そ れらの組の位相が確定することになる。安定なモード同期 のためには、このような相互注入同期が連鎖状に起きて、 多くの組が関与することが必要である。

他の組についても同様な解析を行うと、表1に示した可 能な定常位相の組み合わせが得られる。この表では、現れ た全ての組(二重線で囲まれたモード)が、隣接した組と相 互注入同期すると仮定している。

縦モード0については、図16に示した8つの位相状態 が可能である。各位相について出力光パルスの包絡線の時 間変化を調べると、黒丸の状態(n=0、±2、4)では出力パル スが入力パルスと同じ時刻に発生し、白丸の状態(n=±1、 ±3)では半周期(1/2f₀)ずれた時刻に発生することが分かる (図17)。他の縦モードについても調べると、可能な位相状

表1 各モードの可能な定常位相の組み合わせ

ŧ-ŀ'	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4
位相	- <i>φ</i> -2	¢ -2	- ¢ -1	φ-1	- \$ 0	φo	- \$ +1	φ +1	- ¢ +2	¢ +2
	-nπ/4	n π/4	3n π /4	-3n π /4	-nπ/4	nπ/4	3n π /4	-3n π /4	-nπ/4	nπ/4
д=-3	3π/4	-3 π/4	-π/4	π/4	3π/4	-3 π /4	-π/4	π/4	3π/4	-3π/4
n=-2	π/2	- π/2	-3π/2	3π/2	π/2	-π/2	-3π/2	3π/2	π/2	-π/2
n=-1	π/4	-π/4	-3π/4	3π/4	π/4	-π/4	-3π/4	3π/4	π/4	-π/4
n= 0	0	0	0	0	· 0	0	0	0	0	0
n=+1	-π/4	π/4	3π/4	3π/4	-π/4	π/4	3π/4	-3π/4	-π/4	π/4
n=+2	-π/2	π/2	3π/2	-3 π/2	-π/2	π/2	3π/2	-3'π/2	-π/2	π/2
n=+3	-3π/4	3π/4	π/4	-π/4	-3π/4	3π/4	π/4.	-π/4	'-3π/4	3π/4
n=+4	-π	π	3π	-3π	·π	π	3 π	-3 m	-π	π

態は図 16 と同じになり、且つ、黒丸の状態(n=0、±2、4) では出力パルスが入力パルスと同じ時刻に発生し、白丸の 状態(n=±1、±3)では半周期(1/2f₀)ずれた時刻に発生する ことが分かる。



n=0 の場合は、二分周パルスの出力の包絡線が時刻 $\pm 2 \pi n/(\omega_0/2)=\pm 2n/f_0$ でピークとなるのは明らかであり、 入力パルスと同じ時刻に発生する。

例として、n=+1 の場合について出力光パルスの包絡線の時間変化を調べると次のようになる。ここで、 ω_{o} はF-PLD2のモード0の角周波数、 $\omega_{0}/2$ はF-PLD2の縦モード角周波数間隔(=周波数間隔 $f_{0}/2$)である。また、各モードの電界振幅 E_{i} は正の実数である。

 $E(t)=...+E_{-4}exp\{j(\omega_{c}-4\omega_{0}/2)t+j\pi/4\}$

+E₋₃exp{ $j(\omega_c-3\omega_0/2)t+j3\pi/4$ }

+E₋₂ $exp{j(\omega_c-2\omega_0/2)t-j3\pi/4}$

+E₋₁exp{ $j(\omega_c - \omega_0/2)t - j\pi/4$ }+E₀exp($j\omega_c t + j\pi/4$)

+E₊₁exp{ $j(\omega_{c}+\omega_{0}/2)t+j3\pi/4$ }

(3)

$$\begin{split} + & E_{+2} exp \{j(\omega_{c}+2\omega_{0}/2)t-j\pi/4\} \\ + & E_{+3} exp \{j(\omega_{c}+3\omega_{0}/2)t-j\pi/4\} \\ + & E_{+4} exp \{j(\omega_{c}+4\omega_{0}/2)t+j\pi/4\} + ... + c.c. \\ = & exp(j\omega_{c}t+j\pi/4)[\dots+E_{-4} exp \{-j4\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} \\ + & E_{-3} exp \{-j3\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} \\ + & E_{-2} exp \{-j2\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} \\ + & E_{-1} exp \{-j\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} + \\ + & E_{+1} exp \{j\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} + \\ + & E_{+2} exp \{j2\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} \\ + & E_{+3} exp \{j3\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} \\ + & E_{+4} exp \{j4\omega_{0}/2(t+\pi/\omega_{0})\} + \dots] + c.c. \end{split}$$

 $\equiv exp(j \omega_{c}t+j \pi/4) E_{env}(t+\pi/\omega_{0}) + c.c.$

 $E_{em}(t)$ は包絡線の形を与える部分である。 $t + \pi / \omega_0$ の関数と して考えれば、全ての縦モードの位相は揃っており、繰り 返し角周波数 $\omega_0/2$ (=繰り返し周波数 $f_0/2$)のモード同期状 態である。 $E_{em}(t)$ は、時刻 $-\pi / \omega_0 \pm 4\pi n / \omega_0 = -1/(2 f_0) \pm 2n / f_0$ で最大となる。但し、n は整数である。一方、注入光の位 相は全て 0 としているから、注入光電界の包絡線は $\pm 2\pi n / \omega_0 = \pm n / f_0$ で最大となる。すなわち、繰り返し周波 数 f_0 の入力パルス列に対して、その半周期分(1/2 f_0)ずれた タイミングで二分周パルス列が発生する。

他のnについても同様に計算すればよい。

6・2 二分周動作の安定性解析

実際には、縦モードの組内における相互注入同期と、組 間の相互注入同期の両方が同時に作用する。この状況下で の安定性を調べるため、各縦モードの位相に摂動を加えて PLLモデルにより解析した。

組内と組間の相互注入同期が同時に作用する場合は、複数個の入力がある PLL モデルで各縦モードを表現すればよい(図 18)。各入力に対するループ利得の大きさ(K₁、K₂、…)は、①三次非線形係数の大きさ、②入力光電界強度、③励起光電界強度、④その縦モードの電界強度、に依存する。したがって、一般には互いに異なった値になる。



図 18 入力が複数の PLL モデル

前節で述べたように、位相が確定するための基本過程は、 隣接する、相互注入同期した組が互いに相互注入同期する ことである。したがって、この基本過程に限定して安定性 解析を行えばよい。

図 18 で、モード-3~0の関係する基本過程には次のもの が含まれる。

(1)組内の相互注入同期: M-1(モード-3と-2)、

(2)組間の相互注入同期: I1(励起光=モード-2、

信号光=モード-3、

I₂(励起光=モード-1、

信号光=モード-2、

被注入光=モード 0)

簡単化のため、モード-3~0の光電界強度は全て等しいと すると、PLLモデルにおけるループ利得の大きさは組内の 相互注入同期に関する K_mと、組間の相互注入同期に関す る K_iの二つを考えればよいことになる。

各縦モードの位相に摂動を加え、その時間変化を追えば、 安定性を解析できる。各縦モードの位相について、表1の 任意のn(=-3~+4)に対応する定常位相からのずれを改めて θ_i (i=-3~0)とおくと、上記(1)と(2)の過程を取り入れた次 の連立微分方程式が得られる。

$$\begin{cases} \hat{\theta}_{0} = K_{m}(-\theta_{-1}-\theta_{0}) + K_{i}(2\theta_{-1}-\theta_{-2}-\theta_{0}) \\ \hat{\theta}_{-1} = K_{m}(-\theta_{0}-\theta_{-1}) + K_{i}(2\theta_{-2}-\theta_{-3}-\theta_{-1}) \\ \hat{\theta}_{-2} = K_{m}(-\theta_{-3}-\theta_{-2}) + K_{i}(2\theta_{-1}-\theta_{0}-\theta_{-2}) \\ \hat{\theta}_{-3} = K_{m}(-\theta_{-2}-\theta_{-3}) + K_{i}(2\theta_{-2}-\theta_{-1}-\theta_{-3}) \end{cases}$$
(4)

但し、 $| \theta_i | \ll 1$ であり、sin($\theta_i - \theta_j$) = $\theta_i - \theta_j$ 、 sin($2\theta_i - \theta_j = \theta_i - \theta_j$ 、 sin($2\theta_i - \theta_i - \theta_k$ 、が成り立つとしている。

(4)式は初期値を与えれば解ける。次のように、ラプラス 変換による方法が見通しがよい。(4)式をラプラス変換して、 行列形式で表すと次式が得られる。但し、 $\Theta_i(s)$ は $\theta_i(t)$ の ラプラス変換であり、各摂動の初期値 $\theta_i(t)=0$ 、且つ、各 PLL の VOC 入力にインパルス雑音 $A_0 \delta(t)$ 、 $A_1 \delta(t)$ 、 $A_2 \delta(t)$ 、 $A_3 \delta(t)$ が加わったとしている。



左辺第一項の行列の行列式を因数分解することにより、解の時間変化の形が分かる。因数分解形は $s(s+2 K_m)^2(s+4 K_i)$ であるから、解は定数項、及び時間と共に $exp(-2 K_m t)$ 、 $texp(-2 K_m t)$ 、 $exp(-4 K_i t)$ で変化する項の重ね合わせになる。

時間と共に変化する項は、t→∞で全てが 0 に収束する。 しかし、定数項は一般には0ではない。次に、この定数項 を調べてみる。

(5)式を解いて、最終値定理 *lim s*F(*s*)=*lim f*(*t*)を用いると 次の結果が得られる。

$$\begin{pmatrix} \theta_{0}(\infty) \\ \theta_{-1}(\infty) \\ \theta_{-2}(\infty) \\ \theta_{-3}(\infty) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\phi_{m} + \phi_{i} \\ \phi_{m} + \phi_{i} \\ \phi_{m} + \phi_{i} \\ -\phi_{m} + \phi_{i} \end{pmatrix}$$
(6)

 $(\underline{H} \ \underline{U}, \phi_{m} = \frac{-A_{0} + A_{-1} + A_{-2} - A_{-3}}{4}, \phi_{i} = \frac{K_{i}}{4K_{ni}}(-A_{0} + A_{-1} + A_{-2} - A_{-3})$

 ϕ_i は組間の相互注入同期に対する PLL ループ利得に比例 する。一方、 ϕ_m は、見かけ上は PLL ループ利得に依存し ないが、 $K_i \rightarrow 0$ でも 0 にはならない。したがって、 ϕ_m は 組内の相互注入同期の寄与によるものであり、一方、 ϕ_i は組間の相互注入同期の寄与によるものであると考えら れる。(6)式で、 $\theta_0(\infty)$ 、 $\theta_{-1}(\infty)$ 、 $\theta_{-2}(\infty)$ 、 $\theta_{-3}(\infty)が\phi_m$ と ϕ_i にどう関係するかを見ると、各機構の作用は次のよ うであることが分かる。

(1)組内の相互注入同期は、二つの縦モードの定常位相が逆符号となるように作用する。

(2)組間の相互注入同期は、全ての縦モードの定常位相 を同じ量だけシフトさせる。

各縦モードの定常位相は上記(1)、(2)の重ね合わせである。(2)の同一量の位相シフトはパルス包絡線の形を変えないので、図16の入出力の相対関係には影響を及ぼさない。

(6)式は、初期値 $0(=\theta_0(0)=\theta_{-1}(0)=\theta_{-2}(0)=\theta_{-3}(0))$ で、各 PLL の VCO 入力にインパルス雑音 $A_0 \delta(t)$ 、 $A_1 \delta(t)$ 、 $A_2 \delta(t)$ 、 $A_3 \delta(t)$ が加わったときの定常位相である。 $\phi_m と \phi_i$ は一般には 0 でないから、インパルス雑音が加わる毎 に元の定常位相から少しずれることになる。種々のインパ ルス雑音が加わった結果を考えるには、(6)式の集合平均を 取ればよい。 $\langle A_0 \rangle$ av= $\langle A_1 \rangle$ av= $\langle A_2 \rangle$ av= $\langle A_3 \rangle$ av=0 であるか ら、 $\langle \phi_m \rangle$ av= $\langle \phi_i \rangle$ av=0 となる。すなわち、定常位相の周 りに揺らぐことを表す。その揺らぎの大きさは、インパル ス雑音の大きさ(A_0 、 A_1 、 A_2 、 A_3)とループ利得(K_m 、 K_i) によって決まる。

F-P LD における縦モード間の相互注入同期を利用した モード同期光パルス列の繰り返し周波数の二分周動作で は、図 16 と図 17 に示したように複数の状態が可能である。 PLL モデルによる解析からは、全てが安定であることが分 かった。

一方、PLL モデルに取り入れられていない効果によって、 一部の状態が実際には現れないという可能性はある。本解 析では、時間的なパルスの重なり具合にかかわらずループ 利得 K_mと K_iは一定としている。しかし、二つの光は LD 内のキャリアを介して相互作用すると考えられるから、直 感的には、パルスが時間的に重なる状態の方がより大きな ループ利得になって、この状態のみが現れると考えられる。 今後は、まず実験で確かめ、次にその結果を解析するとい う方針で進める。

7. まとめ

cw 光注入による半導体レーザの全光制御モード同期法 に関し、再現性を向上するための手法を提案すると共に、 実験確認を行った。実験系での微弱な外部反射により、パ ルスの特性が変化することを抑えるために、外部共振器と して結合用セルフォックレンズを用いる手法を提案した。 実験では、セルフォックレンズのフリースペクトルレンジ が F-P LD の縦モード間隔と整数比になるように調整し、 F-P LD の外部共振器として作用させる手法の有効性を調 べた。その結果、再現性が向上し、同期周波数範囲が拡大 することが分かった。また、注入光強度の大きさによって、 出力パルスの形状が定性的に変化することも分かった。出 力光から cw 注入光の成分を除去する手法、或いは強度調 整する手法を検討すると共に、F-P LD の縦モード周波数 間隔に等しい繰り返し周波数の光パルスと、その 1/2 の繰 り返し周波数の光パルス列を生成できる可能性があるこ とを示した。

今後は、出力光から cw 注入光の成分を除去、或いは強 度調整する手法の実験検討を進め、一層の再現性向上を図 る予定である。

また、cw 光注入による全光制御モード同期法の原理を 応用した、モード同期パルス列の繰り返し周波数の二分周 法について、PLL モデルを用いた定量的な検討を進めた。 定常位相を詳細に調べると共に、安定性解析を行った。そ の結果、入力パルス列と、二分周された出力パルス列との 時間関係には、パルスが重なる状態と、重ならない状態の 二種類の安定状態があることが分かった。

参考文献

1) 横山:高安定モード同期半導体レーザー,レーザー研究,Vol.27,No.11,pp.750-755(1999)

2) M.D.Pelusi et al.,"THz optical beat frequency generation from a single mode locked semiconductor laser", *Appl.Phys. Lett.*, Vol.71, NO.4, pp449-450(1997)

3) H.Kasuya et al.,"All optical mode locking of Fabry-Perot laser diode via mutual injection locking between two longitudinal modes", *Appl.Phys.Lett.*, Vol.75, No.1, pp. 13-15 (1999)

4) 水池他:外部共振器を用いた Fabry-Perot LD の自己モード同期による高繰り返し光パルス列の生成,2000 年電子 情報通信学会ソサイエティ大会,C-4-5 5) 鈴木他: Fabry-Perot LD を用いた全光制御モード同期 の発振特性とその応用,愛知工業大学研究報告, No.36,pp.209-216(2001)

6) 森他:Fabry-Perot LD の縦モード間相互注入同期と注 入同期を用いたモード同期パルス列の分周と逓倍,2001 年 電子情報通信学会総合大会,C-4-14

 7) 鈴木他:連続光注入による共振器長 900 μ m
 Fabry-Perot LD の全光制御モード同期における繰り返し周 波数の制御, 2000 年電子情報通信学会ソサイエティ大 会,C-4-4

(受理 平成14年3月19日)